

MAGNETIC DISK DEVICE

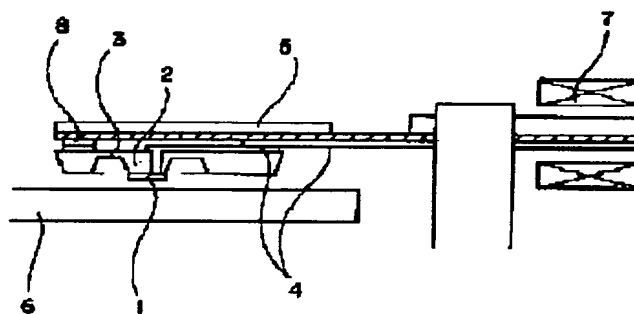
Patent number: JP9035230
Publication date: 1997-02-07
Inventor: HARADA TAKESHI; AKASHI TERUHISA; IMAI SATOMITSU
Applicant: HITACHI LTD
Classification:
- international: **G11B5/31; G11B5/49; G11B5/60; G11B21/21; G11B25/04; G11B5/31; G11B5/49; G11B5/60; G11B21/21; G11B25/04; (IPC1-7): G11B5/60; G11B5/31; G11B5/49; G11B21/21; G11B25/04**
- european:
Application number: JP19950177131 19950713
Priority number(s): JP19950177131 19950713

[Report a data error here](#)

Abstract of JP9035230

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a magnetic disk device for detecting information recording with high reliability at a low cost for an information memory device with which large-capacity recording is possible.

SOLUTION: This magnetic head supporting mechanism is made of a single crystal silicon material and has a three-dimensional integral structure consisting of a magnetic head 1, a slider 2, gimbals 3 for holding its posture and electric wirings 4 near the front end of the mechanism. The mechanism further has a connection structure to be joined to an arm 5 via the electric wirings 4. Further, the magnetic head supporting mechanism is connected to an actuator 7 for positioning and is positioned to the arbitrary position on the surface of a magnetic recording medium 6 to execute recording and detecting of information. Consequently, the floating of the magnetic head with decreased fluctuations and high reliability is made possible and the large-capacity recording and high-speed access operation are embodied. The need for discretely producing and assembling respective parts as before is eliminated and, therefore, the low-cost magnetic head supporting mechanism is obtd.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-35230

(43) 公開日 平成9年(1997)2月7日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 1 1 B 5/60			G 1 1 B 5/60	Z
5/31		9058-5D	5/31	G
5/49			5/49	C
21/21			21/21	A
25/04	1 0 1		25/04	1 0 1 H

審査請求 未請求 請求項の数12 O L (全 9 頁)

(21) 出願番号 特願平7-177131

(22) 出願日 平成7年(1995)7月13日

(71) 出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72) 発明者 原田 武

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所内

(72) 発明者 明石 照久

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所内

(72) 発明者 今井 輝充

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所内

(74) 代理人 弁理士 鶴沼 辰之

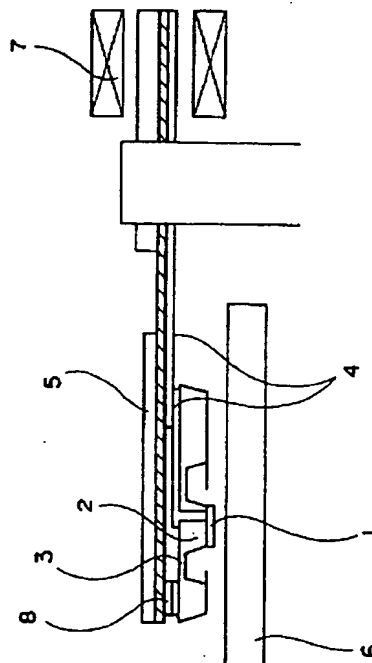
(54) 【発明の名称】 磁気ディスク装置

(57) 【要約】

【目的】 大容量記録が可能な情報記憶装置のための、高信頼性、低コストの情報記録検出用磁気ディスク装置を提供する。

【構成】 磁気ヘッド支持機構は単結晶シリコンを素材とし、先端付近に位置する磁気ヘッド1、スライダ2、その姿勢を保持するジンバル3、電気配線4からなる立体的な一体構造を有し、電気配線4を介したアーム5との接合連結構造を有する。更に、磁気ヘッド支持機構は位置決め用アクチュエータ7に接続され、磁気記録媒体6表面の任意の位置に位置決めして情報の記録・検出を行う。

【効果】 変動の少ない高信頼性の磁気ヘッド浮上が可能となり、大容量記録、高速アクセス動作を実現できる。また、従来のように夫々の部品を個別に製作し、組立てる必要がなくなるので、低コストの磁気ヘッド支持機構が得られる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 回転する円板状の磁気記録媒体に対し情報を記録検出する磁気ディスク装置であって、前記磁気記録媒体に対し略平行になるように設置された薄膜状の磁気ヘッドと、前記磁気ヘッドを支持する磁気ヘッド支持手段とが、シリコン又はシリコン化合物からなる基板上に、一体構造で立体的に形成されていることを特徴とする磁気ディスク装置。

【請求項2】 前記基板は、同一素材の単結晶シリコン基板であることを特徴とする請求項1に記載の磁気ディスク装置。

【請求項3】 前記基板には、前記磁気ヘッドに対し電気信号を入出力する電気配線が、一体的に形成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の磁気ディスク装置。

【請求項4】 前記磁気ヘッド支持手段は、磁気記録媒体に向かって突出するようにして形成されたスライダ、前記スライダの姿勢を保持するジンバル、又は、前記磁気ヘッドの磁気記録媒体に対する相対位置を決定するアームのうち、少なくともいずれかを含むものであることを特徴とする請求項1、2又は3に記載の磁気ディスク装置。

【請求項5】 回転する円板状の磁気記録媒体に対し情報を記録検出する磁気ディスク装置であって、前記磁気記録媒体に対し略平行になるように設置された薄膜状の磁気ヘッドを有し、前記磁気記録媒体に向かって突出するようにして形成されたスライダと、前記磁気ヘッドに対し電気信号を入出力する電気配線及び金属パッドと、前記スライダの姿勢を保持するジンバルとを、同一素材の単結晶シリコン基板から一体形成して磁気ヘッド・スライダ・電気配線一体化ジンバルを構成し、前記一体化ジンバルと、前記磁気ヘッドの磁気記録媒体に対する相対位置を決定するアームとが、前記アームの表面に絶縁層を挟んで付設された電気配線及び金属パッドと、前記一体化ジンバルの表面の電気配線及び金属パッドとの各々同士の接合により連結されてなる磁気ヘッド支持手段を具備することを特徴とする磁気ディスク装置。

【請求項6】 回転する円板状の磁気記録媒体に対し情報を記録検出する磁気ディスク装置であって、前記磁気記録媒体に対し略平行になるように設置された薄膜状の磁気ヘッドを有し、前記磁気記録媒体に向かって突出するようにして形成されたスライダと、前記磁気ヘッドに対し電気信号を入出力する電気配線と、前記スライダの姿勢を保持するジンバルと、前記磁気ヘッドの磁気記録媒体に対する相対位置を決定するアームとを、同一素材の単結晶シリコン基板から一体形成して構成した磁気ヘッド・スライダ・電気配線・ジンバル・アーム一体化磁気ヘッド支持手段を具備することを特徴とする磁気ディスク装置。

【請求項7】 回転する円板状の磁気記録媒体に対し情

2

報を記録検出する磁気ディスク装置であって、前記磁気記録媒体に対し略平行になるように設置された薄膜状の磁気ヘッドと、前記磁気ヘッドに対し電気信号を入出力する電気配線と、前記磁気ヘッドの姿勢を保持するジンバルと、前記磁気ヘッドの磁気記録媒体に対する相対位置を決定するアームとを、同一素材の単結晶シリコン基板から一体形成して構成した磁気ヘッド・電気配線・ジンバル・アーム一体化磁気ヘッド支持手段を具備することを特徴とする磁気ディスク装置。

10 【請求項8】 回転する円板状の磁気記録媒体に対し情報を記録検出する磁気ディスク装置であって、前記磁気記録媒体に対し略平行になるように設置された薄膜状の磁気ヘッドを有し、前記磁気記録媒体に向かって突出するようにして形成されたスライダと、前記磁気ヘッドに対し電気信号を入出力する電気配線と、前記磁気ヘッドの磁気記録媒体に対する相対位置を決定するアームとを、同一素材の単結晶シリコン基板から一体形成して構成した磁気ヘッド・スライダ・電気配線・アーム一体化磁気ヘッド支持手段を具備することを特徴とする磁気ディスク装置。

20 【請求項9】 回転する円板状の磁気記録媒体に対し情報を記録検出する磁気ディスク装置であって、前記磁気記録媒体に対し略垂直になるように設置された薄膜状の磁気ヘッドを側面に有するとともに、前記磁気記録媒体の対向面の裏面に金属パッドを有し、前記磁気記録媒体に向かって突出するようにして形成された単結晶シリコンからなるスライダと、前記磁気ヘッドに対し電気信号を入出力する電気配線及び金属パッドと、前記スライダの姿勢を保持するジンバルと、前記磁気ヘッドの磁気記録媒体に対する相対位置を決定するアームとを、同一素材の単結晶シリコン基板から一体形成して電気配線・ジンバル一体化アームを構成し、前記一体化アームが、前記磁気ヘッド・スライダの電気配線及び金属パッドの各々同士と接合により連結されてなる磁気ヘッド支持手段を具備することを特徴とする磁気ディスク装置。

30 【請求項10】 前記電気配線は、Cu、Al、Auの中から選ばれる金属、あるいはその合金か、あるいはそれらとはんだ合金との多層膜からなることを特徴とする請求項5ないし9のうちいずれかに記載の磁気ディスク装置。

40 【請求項11】 前記金属パッドは、Cu、Al、Auの中から選ばれる金属、あるいはその合金か、あるいはそれらとはんだ合金との多層膜からなることを特徴とする請求項5又は9に記載の磁気ディスク装置。

50 【請求項12】 前記接合は、接合される面の表面を真空中あるいは清浄雰囲気チャンバの中で不活性原子あるいはイオンビームエッチングで清浄化したのちに、接合すべき部材同士を室温に近い温度で加熱・加圧する表面活性化接合であることを特徴とする請求項5又は9に記載の磁気ディスク装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は磁気ディスク装置に係り、特に、コンピュータやデータファイリングシステムなどの情報処理機器の外部メモリ装置の一部品として用いられ、超薄型磁気ディスクメモリカードや超小型磁気ディスクアレイに好適な超小型磁気ヘッド支持機構を具備する磁気ディスク装置に関する。

【0002】

【従来の技術】磁気ディスクや光ディスクに代表される情報記憶装置は、コンピュータやデータファイリングシステムなどの情報処理機器の外部メモリ装置として用いられ、特に最近では超薄型磁気ディスクメモリカードや超小型磁気ディスクアレイなどの、従来と異なるコンセプトの磁気ディスク装置が必要とされている。これらの情報記憶装置においては、装置の薄型化・小型化と情報記録容量の増大に伴う記録密度の向上、並びに、情報処理速度の高速化に伴うアクセス速度の高速化が望まれている。

【0003】これらの要請に応えるためには、情報記録媒体と情報記録検出用磁気ヘッドの間隔（以下、浮上量という）とその変動の低減が必要になる。また、磁気ヘッド支持機構の薄型化及び共振周波数の向上が必要になる。一般に普及している磁気ディスク装置においては、ディスク（円板）形状を有する磁気記録媒体を回転させ、その近傍に磁気ヘッドを装着した空気軸受（スライダ）を接近させる。その結果生じる磁気記録媒体とスライダとの間の空気流による浮力と、スライダを支持するジンバルとアームによる押しつけ力の均衡により、前記浮上量が適宜決定され、情報の記録及び検出が行われる。

【0004】浮上量とその変動を低減するために各種の方式が提案されている。スライダの寸法を小さくすることによって効果的に浮上量を低減することができるが、現在の機械加工技術では微小化及び加工精度に限界がある。また、微小なスライダ、ジンバル及びアームのハンドリングや組立も困難になり、生産コストを著しく上げる要因となっている。

【0005】微小なスライダの加工の生産性を改善する方法として、例えば、IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, VOL. 25, NO. 5, pp. 3190 (1989)に記載のように、磁気ヘッドの磁場印加検出用渦巻状コイルの形成する平面が、磁気記録媒体と向かいあう面（浮上面）に略平行になるように設置され、半導体シリコン基板からスライダと磁気ヘッドが半導体加工技術及び機械加工技術により形成される方法が提案されている。本方法は微小なスライダの大量生産方法として有力になり得る方法である。

【0006】また、スライダとジンバルとアームの組立

を省く方法として、例えば、特開平2-227813号公報に記載のように、スライダをなくして、磁気ヘッド支持部材の表面に一体的に磁気ヘッドを作り込む構造が提案されている。また、特開平6-5026号公報に記載のように、磁気ヘッドからアームまでを同一部材を使って一体化する構造が提案されている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】低浮上量化の従来例として挙げたように、半導体シリコン基板上にスライダとその情報記録媒体と向かいあう面に配置されてなる磁気ヘッドが、半導体加工技術により形成される方法では、スライダの外形形状の成形のために従来の機械加工技術を用いているので、スライダの寸法が小さくなると、加工寸法精度の維持及びハンドリングが困難になる。また、磁気ヘッドの支持部材との組立工程が考慮されていないために、スライダの寸法を小さくするほど、スライダとジンバルとアームとの組立が困難になるという問題があった。

【0008】また、スライダをなくして、磁気ヘッド支持部材の表面に一体的に磁気ヘッドを作り込む構造では、磁気ヘッドと支持部材の材質の整合性について考慮されておらず、磁気ヘッド製作工程において支持部材との界面に応力が加わり、歪みが残る。また、スライダをなくしたために、スライダの表面に形成される浮上レールがなく、浮上量の変動を抑制するのが困難である。さらに、磁気ヘッドが薄膜構造であるために、アームにより情報記録媒体の方向に押しつけられる際に撓むジンバルが情報記録媒体に接触して、安定浮上が実現されないという問題があった。

【0009】また、磁気ヘッドからアームまでを同一部材を使って一体化する構造では、磁気ヘッドが磁気記録媒体に対して略垂直に形成されており、磁気ヘッドを含めた構造体をエッチング加工で製作する工程、磁気ヘッドに電気信号を入出力する電気配線の接続方法が記載されておらず、その構造をエッチング加工で実現するのは非常に困難と考えられる。

【0010】本発明の目的は、浮上量を低く維持し、大容量記録、高速アクセス動作の可能な、薄型・超小型磁気ヘッド支持機構を有する磁気ディスク装置を提供することにある。

【0011】

【課題を解決するための手段】上記目的は、磁気ヘッド支持手段を、同一の単結晶シリコン基板上に、少なくとも薄膜形成技術、微細パターンの転写露光技術、異方性及び等方性エッチング技術、並びにめっき技術を含むマイクロ加工技術と表面活性化接合技術により一体で立体的に形成することにより達成できる。

【0012】すなわち、本発明の磁気ディスク装置は、回転する円板状の磁気記録媒体に対し情報を記録検出する磁気ディスク装置であって、前記磁気記録媒体に対し

略平行になるように設置された薄膜状の磁気ヘッドと、前記磁気ヘッドを支持する磁気ヘッド支持手段とが、シリコン又はシリコン化合物からなる基板上に、一体構造で立体的に形成されていることを特徴とするものである。

【0013】また、前記基板は、同一素材の単結晶シリコン基板であることを特徴とし、また、前記基板には、前記磁気ヘッドに対し電気信号を入出力する電気配線が、一体的に形成され、また、前記磁気ヘッド支持手段は、磁気記録媒体に向かって突出するようにして形成されたスライダ、前記スライダの姿勢を保持するジンバル、又は、前記磁気ヘッドの磁気記録媒体に対する相対位置を決定するアームのうち、少なくともいずれかを含むものである。

【0014】さらに具体的には、本発明の磁気ディスク装置は、磁気記録媒体に対し略平行になるように設置された薄膜状の磁気ヘッドと、前記磁気ヘッドを支持し、磁気記録媒体に向かって突出するようにして形成された空気軸受（スライダ）と、磁気ヘッドに対し電気信号を入出力する電気配線と、前記スライダの姿勢を保持する可撓性部材（ジンバル）を同一素材の単結晶シリコン基板から一体形成して構成した磁気ヘッド・スライダ・電気配線一体化ジンバルと、表面に絶縁層を挟んで形成された電気配線及び金属パッドを有し磁気ヘッドの磁気記録媒体に対する相対位置を決定する金属製支持部材（アーム）とを、それぞれの電気配線及び金属パッド同士の接合により連結した磁気ヘッド支持手段を有するものである。

【0015】また、磁気記録媒体に対し略平行になるように設置された薄膜状の磁気ヘッドと、前記磁気ヘッドを支持し、磁気記録媒体に向かって突出するようにして形成された空気軸受（スライダ）と、磁気ヘッドに対し電気信号を入出力する電気配線と、前記スライダの姿勢を保持する可撓性部材（ジンバル）と、磁気ヘッドの磁気記録媒体に対する相対位置を決定する金属製支持部材（アーム）とを同一素材の単結晶シリコン基板から一体形成して構成した磁気ヘッド・スライダ・電気配線・ジンバル・アーム一体化磁気ヘッド支持手段を有するものである。

【0016】また、磁気記録媒体に対し略平行になるように設置された薄膜状の磁気ヘッドと、前記磁気ヘッドに対し電気信号を入出力する電気配線と、前記スライダの姿勢を保持する可撓性部材（ジンバル）と、磁気ヘッドの磁気記録媒体に対する相対位置を決定する支持部材（アーム）とを同一素材の単結晶シリコン基板から一体形成して構成した磁気ヘッド・電気配線・ジンバル・アーム一体化磁気ヘッド支持手段を有するものである。

【0017】また、磁気記録媒体に対し略平行になるように設置された薄膜状の磁気ヘッドと、前記磁気ヘッドを支持し、磁気記録媒体に向かって突出するようにして

形成された空気軸受（スライダ）と、磁気ヘッドに対し電気信号を入出力する電気配線と、磁気ヘッドの磁気記録媒体に対する相対位置を決定する金属製支持部材（アーム）とを同一素材の単結晶シリコン基板から一体形成して構成した磁気ヘッド・スライダ・電気配線・アーム一体化磁気ヘッド支持手段を有するものである。

【0018】また、磁気記録媒体に対し略垂直になるように設置された薄膜状の磁気ヘッドと、前記磁気ヘッドをその端面に有し、磁気記録媒体に向かって突出するようにして形成された空気軸受（スライダ）と、磁気ヘッドに対し電気信号を入出力する電気配線と、前記スライダの姿勢を保持する可撓性部材（ジンバル）と磁気ヘッドの磁気記録媒体に対する相対位置を決定する支持部材（アーム）とを同一素材の単結晶シリコン基板から一体形成して構成した電気配線・ジンバル一体化アームとを、磁気ヘッドの電気配線との接合により連結した磁気ヘッド支持手段を有するものである。

【0019】さらに、前記電気配線、あるいは金属パッドは、Cu、Al、Auの中から選ばれる金属、あるいはその合金か、あるいはそれらとはんだ合金との多層膜からなることが望ましい。

【0020】さらに、前記接合は、接合される面の表面を真空あるいは清浄雰囲気チャンバの中で不活性原子あるいはイオンビームエッチングで清浄化したのちに、接合すべき部材同士を室温に近い温度で加熱・加圧する表面活性化接合であることが望ましい。

【0021】

【作用】上記構成のように、磁気ヘッド、スライダ、電気配線、ジンバルなどを適宜組合わせ、例えば同一素材を用いて一体構造に形成すると、磁気ヘッド支持手段の先端に微小な磁気ヘッドとスライダ部を、例えばジンバルとの組立工程なしに設置することができる。また、単結晶シリコンによれば、密度が低く軽質量であり、したがって、共振周波数の高い浮上動作が可能となり、変動の少ない安定な低浮上を実現することができる。

【0022】さらに、従来のように、磁気ヘッドスライダ、電気配線、ジンバル、アーム等、それぞれの部品を個別に製作し、組立てる必要がなくなるので、低コストの情報記録検出用磁気ヘッド手段を得ることができる。

【0023】また、薄膜形成技術、微細パターンの転写露光技術、異方性及び等方性エッチング技術、めっき技術等からなる単結晶シリコンのマイクロ加工技術によると、低浮上量化に適した超小型の磁気ヘッド支持手段を製作するのに効果的である。

【0024】

【実施例】以下、本発明の実施例を、図面を参照して説明する。図1に、本発明の第1の実施例になる磁気ディスク装置の斜視図を示す。磁気記録媒体6に対し、位置決め用アクチュエータ7によって旋回するアーム5の先

端付近に付設された磁気ヘッド（図では見えない位置にある）付きスライダ2が、位置決めされ情報が記録検出される。本実施例により、薄型の磁気ヘッド支持機構が得られ、その結果として、全体の筐体の薄い高密度記録の可能な磁気ディスク装置が構成できる。

【0025】図2に、本発明の第1の実施例における要部である磁気ヘッド支持機構の断面図を示す。磁気ヘッド支持機構は磁気ヘッド1、スライダ2、その姿勢を保持するためのジンバル3、電気配線4及びアーム5からなり、磁気ヘッド1から電気配線4までが、シリコン単結晶基板からマイクロ加工技術により立体形状に成形される。一方、アーム5は金属を用いたホットエッチング加工により外形加工され、曲げ剛性を高めるために、長手方向に対する側端部の一部が曲げ加工により成形される。そして、両者が接合された構造を有する。

【0026】スライダ2は長さ1mmあるいはそれ以下、厚さ数百 μm 、ジンバル3は長さ数mm、厚さ数十 μm で、スライダ2がジンバル3に比べて十分厚く、スライダ2が磁気記録媒体6に向かって突出するように設置される。さらに、アーム5の一端を位置決め用アクチュエータ7に連結して、磁気記録媒体表面の任意の位置に位置決めして情報の記録・検出を行う。

【0027】ここで、本発明の新規性は、磁気ヘッド1、スライダ2、ジンバル3、電気配線4、アーム5の全部、あるいは、ある一部分が、同一材料の単結晶シリコン基板からなる立体的な一体構造を有し、残りの部分が少なくとも電気配線4自身を介した表面活性化接合により連結されるところにある。尚、本発明では、同一材料の単結晶シリコン基板が好ましいが、必ずしもそれに限定されず、一体構造であれば、Si化合物でもよく、また別材料あるいは多結晶でもよい。

【0028】表面活性化接合とは、電気配線4の材質に、Cu、Al、Au、それぞれの合金か、あるいはそれらとはんだ合金との多層膜を用い、その表面を真空あるいは清浄雰囲気チャンバの中で、不活性原子あるいはイオンビームエッチングで清浄化したのちに、接合すべき部材同士を室温に近い温度（例えば、室温 $\sim 200^{\circ}\text{C}$ ）で加熱・加圧する方法である。さらに、接合強度を高めるためには、スライダ2とジンバル3のアーム5対向面に、電気配線4と同一材料の接合用金属パッド8を設け接合箇所を増やすことが効果的である。

【0029】図3を用い、磁気ヘッド1についてさらに詳細に説明する。ここでは、磁気ヘッド1の構造を理解しやすくするために、厚さ方向の寸法を拡大・誇張して示した。磁気記録媒体6に接近させて情報を記録検出する磁気ヘッド1は、情報記録検出兼用の電磁誘導ヘッドか、あるいは、情報記録用の電磁誘導ヘッド11と、情報検出用の磁気抵抗効果ヘッド12との複合型ヘッドが用いられる。

【0030】さらに、スライダ2の磁気記録媒体6に対

向する面が、Cuあるいはその合金からなる磁場発生用の渦巻状コイル111の形成する平面に平行に設置されるブレーナ方式の磁気ヘッドである。また、電磁誘導ヘッド11には、渦巻状コイル111による磁場を閉込めるためのパーマロイからなるヨーク112と、その一部分でかつ磁気ヘッドの最表面に端面が露出するようにギャップ113が形成されている。

【0031】磁気ヘッドの全体骨格を形成する素材は、 Al_2O_3 （アルミナ）や SiO_2 （二酸化シリコン）あるいはプラスチックが使用される。一方、渦巻状コイル111の両端部は、磁気ヘッド1のスライダ2との界面に埋設された電極端子13を形成し、そこから、スライダ2を貫通して穿孔されたコンタクトホール21を通して、磁気ヘッドに対し電気信号を入出力するための電気配線4が磁気ヘッド支持機構の表面にマイクロ加工技術により形成されている。

【0032】磁気ヘッド1をスライダ2の表面に形成する方法としては、スライダ2を加工するためのシリコン基板の上に、あらかじめ磁気ヘッド1をマイクロ加工技術により形成しておく方法と、磁気ヘッド1をある基板の上に形成しておいて、スライダ2を加工するためのシリコン基板に接合したのち、磁気ヘッド1の基板をエッチングにより除去する磁気ヘッド移植法が効果的である。

【0033】図4及び図5に、同実施例における磁気ヘッド・スライダ一体化ジンバルの浮上面及びその裏面から見た斜視図を示す。図4に示す浮上面の裏側には、スライダ2の裏面からコンタクトホール（図示していない）を介して電気配線4がジンバル3の表面に形成されている。接合強度を効果的に向上させる金属パッド8も同じ面に形成される。

【0034】図5に示す浮上面側には、突出したスライダ2の磁気記録媒体に対抗する面にある磁気ヘッド1の表面に、電磁誘導ヘッドのギャップ113と磁気抵抗効果ヘッド12の端部が露出して形成されている。なお、実際には渦巻状コイル111とヨーク112は表面からは見えないが、磁気ヘッド1の平面形状を表現するために図示した。さらに、磁気ヘッド1の表面には浮上レール15が形成される。

【0035】ジンバル3の形状の加工方法としては、反応性ガスプラズマを用いる反応性プラズマドライエッチング法を利用するのが、加工寸法精度を確保するのに効果的である。スライダ2を浮上面側に突出するように加工するには、シリコン単結晶基板の結晶方位によって加工速度が著しく異なる異方性ウェットエッチング法を利用するのが効果的である。特に、スライダ2をエッチングしてジンバル3の厚さが数十 μm になるように制御するために、エッチングストップ層として、B（ボロン）ドーピングシリコン層、あるいは SiO_2 層が埋め込まれたシリコン基板を用いることにより、ジンバル3の厚さの

ばらつきを抑制することができる。

【0036】図6に、本発明の第2の実施例になる磁気ヘッド支持機構の断面図を示す。磁気ヘッド支持機構は、磁気ヘッド1、スライダ2、その姿勢を保持するためのジンバル3、電気配線4及びアーム5からなり、シリコン単結晶基板からマイクロ加工技術により立体形状に完全一体成形される。磁気ヘッド1からコンタクトホール21を通して、磁気ヘッド1に対し電気信号を入出力するための電気配線4が、スライダ2の浮上面に対する裏側とジンバル3とアーム5に沿ってエッチング加工やめっきにより形成されている。

【0037】また、アーム5の曲げ剛性を維持しつつ極力軽くするために、ハーフエッチングにより、長手方向に対する側端部の一部が分厚く成形される。本方式では接合による連結を行わないので、磁気ヘッド支持機構の厚さをより薄くすることができる。

【0038】図7に、本発明の第3の実施例になる磁気ヘッド支持機構の断面図を示す。磁気ヘッド支持機構は、磁気ヘッド1、その姿勢を保持するためのジンバル3、電気配線4及びアーム5からなり、シリコン単結晶基板からマイクロ加工技術により立体形状に完全一体成形される。磁気ヘッド1に対し電気信号を入出力するための電気配線4が、ジンバル3とアーム5に沿ってエッチング加工やめっきにより形成されている。製作方法は第2の実施例と同様であるが、本方式ではコンタクトホール21の形成が不要であるので製作が容易である。

【0039】図8に、本発明の第4の実施例になる磁気ヘッド支持機構の断面図を示す。磁気ヘッド支持機構は磁気ヘッド1、スライダ2、電気配線4及びアーム5からなり、シリコン単結晶基板からマイクロ加工技術により立体形状に完全一体成形される。本実施例ではジンバルを省く代わりに、アーム5の厚さを数十 μm 程度に薄くしてスライダ2の姿勢を支持する。磁気ヘッド1に対し電気信号を入出力するための電気配線4が、スライダ2とアーム5に沿ってエッチング加工やめっきにより形成されている。製作方法は第2の実施例と同様であるが、本方式ではジンバルの加工が不要であるので工程が簡略化される。

【0040】図9に、本発明の第5の実施例になる磁気ヘッド支持機構の断面図を示す。磁気ヘッド支持機構は磁気ヘッド1、スライダ2、その姿勢を保持するためのジンバル3、電気配線4及びアーム5からなり、エッチング加工と接合により立体形状に成形される。磁気ヘッド1に対し電気信号を入出力するための電気配線4が、ジンバル3とアーム5に沿って半導体製造技術やめっき技術により形成されている。スライダ2とジンバル3の連結には第1の実施例と同様な電気配線自身を介した接合が用いられる。本実施例では従来構造の磁気ヘッドを利用することができるので、従来機種部品との互換性を保つことができる。なお、スライダ2の材質は従来通り

のセラミックスでもよいが、ジンバル3と同一の材料であるシリコンを用いた方が、接合時の熱膨張率差による歪をなくし高精度の組立が可能になる。

【0041】

【発明の効果】本発明の磁気ディスク装置によると、その先端に微小な磁気ヘッドとスライダを設置することができるようになるため、共振周波数の高い極低浮上が可能となり、変動の少ない高信頼性浮上及び高速アクセス動作を実現することができる。また、薄膜形成技術、微細パターン露光技術、並びに異方性及び等方性エッチング技術により形成する工程によると、従来のようにそれぞれの部品を個別に製作し、組立てる必要がなくなるので、低コストの磁気ヘッド支持機構を得ることができる。また、薄い筐体の磁気ディスク装置を実現することができる。以上のことから、共振周波数が高く変動の少ない極低浮上量動作を維持することにより、大容量記録、高速アクセス動作を可能にする薄型・超小型磁気ディスク装置を低コストで提供することが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る磁気ディスク装置の第1の実施例を示す斜視図。

【図2】本発明に係る磁気ディスク装置の第1の実施例における磁気ヘッド支持機構を示す断面図。

【図3】本発明に係る磁気ディスク装置の第1の実施例における磁気ヘッドを示す断面図。

【図4】本発明に係る磁気ディスク装置の第1の実施例における磁気ヘッド・スライダ・電気配線一体化ジンバルの浮上面裏側を示す斜視図。

【図5】本発明に係る磁気ディスク装置の第1の実施例における磁気ヘッド・スライダ・電気配線一体化ジンバルの浮上面側を示す斜視図。

【図6】本発明に係る磁気ディスク装置の第2の実施例における磁気ヘッド支持機構を示す断面図。

【図7】本発明に係る磁気ディスク装置の第3の実施例における磁気ヘッド支持機構を示す断面図。

【図8】本発明に係る磁気ディスク装置の第4の実施例における磁気ヘッド支持機構を示す断面図。

【図9】本発明に係る磁気ディスク装置の第5の実施例における磁気ヘッド支持機構を示す断面図。

【符号の説明】

- 1 磁気ヘッド
- 2 スライダ
- 3 ジンバル
- 4 電気配線
- 5 アーム
- 6 磁気記録媒体
- 7 位置決め用アクチュエータ
- 8 接合用パッド
- 11 電磁誘導ヘッド
- 12 磁気抵抗効果ヘッド

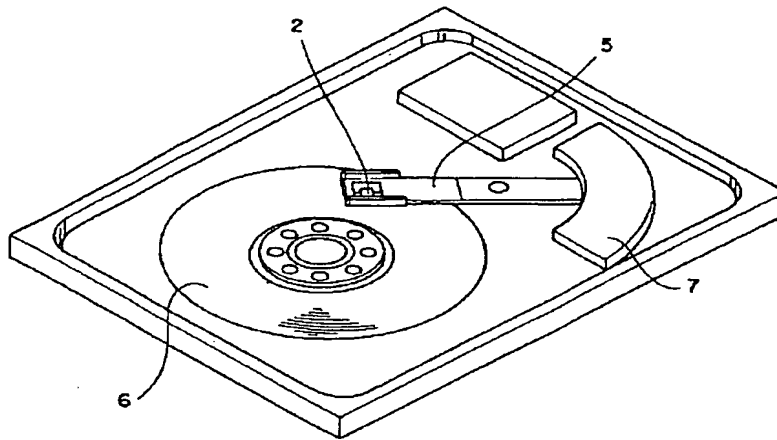
11

12

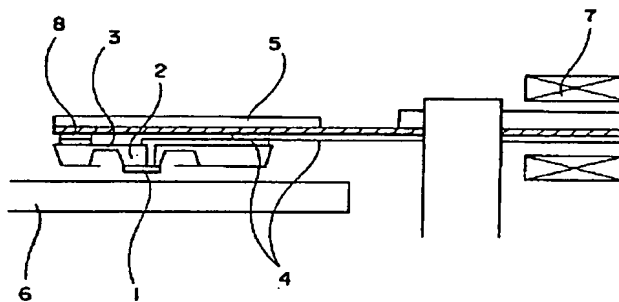
- 13 電極端子
14 浮上レール
21 コンタクトホール

- * 111 渦巻状コイル
112 ヨーク
* 113 ギャップ

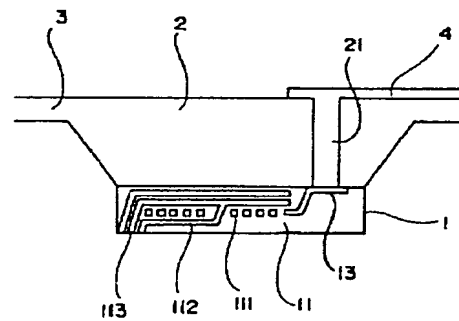
【図1】



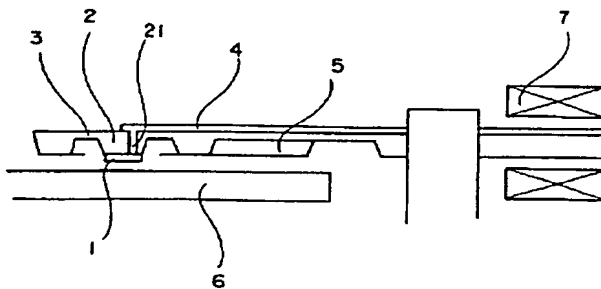
【図2】



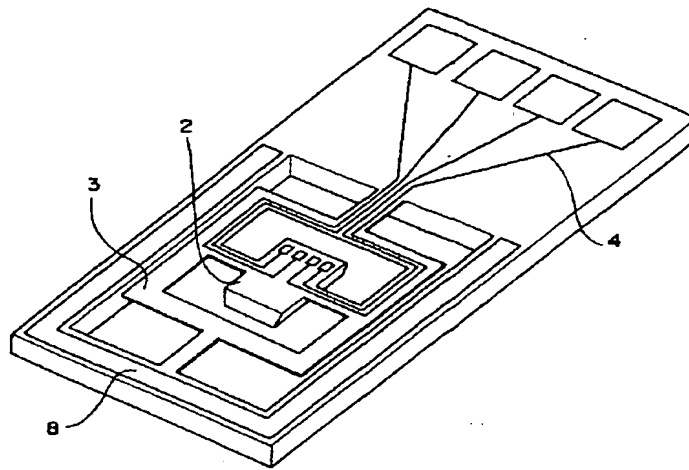
【図3】



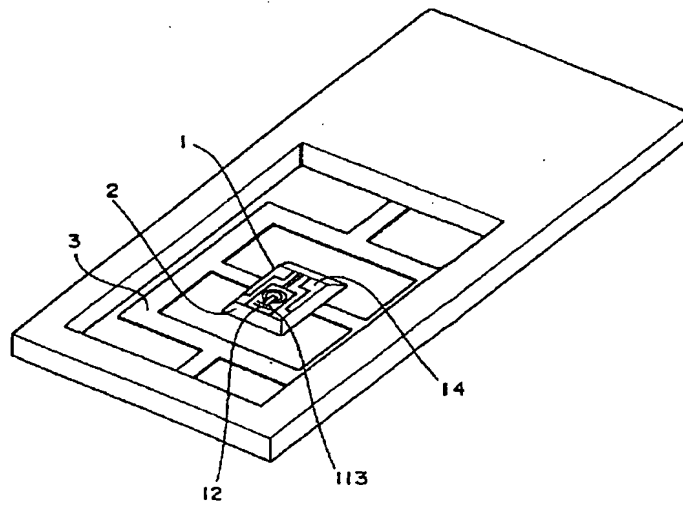
【図6】



【図 4】



【図 5】



【図 7】

